

リモートプラズマ装置

チャンバークリーニング、アッシング、表面改質

- ・ 独自設計の高効率リモートプラズマ

独自のICPコイル設計のSLRP-01は、ガス分解に必要な電磁波をロスを少なく分解室に送り込み、高効率で高密度のプラズマを生成する事が出来ます。



SLRP-01

・ リモートプラズマのメリット

- ・ クリーニングガス低減
- ・ クリーニング速度アップ

リモートプラズマ仕様

項目	仕様
チャンバー	AlN (窒化アルミ)
プラズマ方式	ICP [誘導結合型]
RF周波数	13.56MHz
使用ガス	O ₂ 、Ar、CF ₄
冷却	水冷
接続	応相談
制御方式	外部入出力 (リレー)、RS232
本体サイズ	W350×D350×H400 (mm)、15kg
電源	本体ユニット (AC100V)、電源 (AC200V3相)、50/60Hz

*) 設置台、治具、配管等は、別途協議になります。

・ 取付方法

セッティングは、下記を接続するだけで出来ます

- ・ チャンバーにフランジにて接続
- ・ 使用ガス配管を接続
- ・ 水配管を接続

・ 本カタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。本内容は改良の為予告なく変更する場合があります。
・ このカタログの記載内容については、改良の為に仕様、外観等予告なく変更する事が有ります。
・ このカタログと地齎の商品の色とは、多少異なる場合もあります。
・ このカタログに記載されている製品は国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。

株式会社セルバック

SELVAC Corporation

〒601-8188 京都市南区上鳥羽南中ノ坪町19

TEL (075) 661-2710

FAX (075) 661-2756

Home Page <http://www.selvac.co.jp>**【代理店】**